

# Forno Tubolare Cvd A Più Zone Di Riscaldamento Macchina Cvd

Numero articolo: KT-CTF14



## introduzione

Forno CVD a più zone di riscaldamento KT-CTF14 - Controllo preciso della temperatura e del flusso di gas per applicazioni avanzate. Temperatura massima fino a 1200°C, misuratore di portata massica MFC a 4 canali e controller touch screen TFT da 7".

[Ulteriori informazioni](#)

|  |  |
|--|--|
| Modello del forno                          | KT-CTF14-60  |
| Temperatura massima                        | 1400°C   |
| Temperatura di lavoro costante             | 1300°C   |
| Materiale del tubo del forno               | Tubo Al2O3 di elevata purezza  |
| Diametro del tubo del forno                | 60 mm  |
| Zona di riscaldamento                      | 2x450mm  |
| Materiale della camera                     | Fibra policristallina di allumina  |
| Elemento di riscaldamento                  | Carburo di silicio   |
| Velocità di riscaldamento                  | 0-10°C/min   |
| Coppia termica                             | Tipo S   |
| Regolatore di temperatura                  | Controllore PID digitale/controllore PID touch screen                              |
| Precisione del controllo della temperatura | ±1°C   |
| <b>Unità di controllo preciso del gas</b>  |  |
| Misuratore di portata                      | Misuratore di portata massica MFC  |
| Canali gas                                 | 4 canali   |
| Portata                                    | MFC1: 0-5SCCM O2<br>MFC2: 0-20SCMCH4<br>MFC3: 0-100 SCCM H2<br>MFC4: 0-500 SCCM N2 |
| Linearità                                  | ±0,5% F.S.   |
| Ripetibilità                               | ±0,2% F.S.   |
| Linea di tubi e valvola                    | Acciaio inossidabile   |
| Pressione massima di esercizio             | 0,45MPa  |
| Controllore del flussometro                | Controllore digitale a manopola/controller a schermo tattile                       |
| <b>Unità di vuoto standard (opzionale)</b> |  |
| Pompa per vuoto                            | Pompa per vuoto rotativa a palette   |
| Portata della pompa                        | 4L/S   |
| Porta di aspirazione del vuoto             | KF25   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Vacuometro                       | Vacuometro Pirani/Resistenza al silicone  |
| Pressione nominale del vuoto     | 10Pa                                      |
| Unità per alto vuoto (opzionale) |   |
| Pompa per vuoto                  | Pompa rotativa a palette+pompa molecolare |
| Portata della pompa              | 4L/S+110L/S                               |
| Porta di aspirazione del vuoto   | KF25                                      |
| Vacuometro                       | Vacuometro composto                       |
| Pressione nominale del vuoto     | 6x10-5Pa                                  |

Le specifiche e le configurazioni di cui sopra possono essere personalizzate

| No. | Descrizione                      | Quantità |
|-----|----------------------------------|----------|
| 1   | Forno                            | 1        |
| 2   | Tubo di quarzo                   | 1        |
| 3   | Flangia per il vuoto             | 2        |
| 4   | Blocco termico del tubo          | 2        |
| 5   | Gancio del blocco termico a tubo | 1        |
| 6   | Guanto resistente al calore      | 1        |
| 7   | Controllo preciso del gas        | 1        |
| 8   | Unità per il vuoto               | 1        |
| 9   | Manuale operativo                | 1        |